



(China)

# NEW MULTI-FUNCTIONAL MICRO- AND NANOIMPRINT SOLUTION FROM EV GROUP OFFERS UNPRECEDENTED FLEXIBILITY FOR HIGH-VOLUME OPTICAL DEVICE MANUFACTURING – January 19, 2022

EV Group (EVG), a leading supplier of wafer bonding and lithography equipment for the MEMS, nanotechnology and semiconductor markets, today introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company’s most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. This industry-ready, multi-functional system is designed to serve advanced R&D and production needs for a wide range of emerging applications involving micro- and nano-patterning as well as functional layer stacking.



## EV集团新型多功能纳米压印解决方案为大批量光学设备制造赋予前所未有的灵活性

2022年1月19日 来源: 2022-01-19 16:10 类别: 科技新闻 作者: 廖静美  
EVG®7300是EV集团最先进的解决方案，能够在单个平台中结合多种紫外技术，包括纳米压印光刻 (NIL)、透镜成型和透镜堆叠 (UV键合)

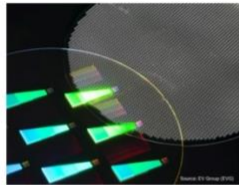
2022年1月19日，奥地利维也纳消息 - 微机电系统 (MEMS)、纳米技术和半导体市场晶圆键合与光刻设备领先供应商EV集团 (EVG) 推出EVG 7300自动SmartNIL®纳米压印与晶圆级光学系统。EVG 7300是EV集团最先进的解决方案，能够在单个平台中结合多种紫外工艺技术，包括纳米压印光刻 (NIL)、透镜成型和透镜片堆叠 (紫外键合)。这些面向行业的多功能系统旨在满足多种新兴应用的研究和生产需求。这些新兴应用大多涉及微和纳米级精密加工以及空前精度要求，包括晶圆级光学系统 (WLO)、光学传感器和摄像头、汽车防撞、增强现实和自动驾驶、生物医学成像、虚拟现实和成像，以及消费电子应用。EVG 7300支持最大300毫米晶圆尺寸，具有高精度、快速工艺和制造高吞吐量等优势，可满足多种自由曲面和超精密纳米和微米级光学元件与组件的大批量制造需求。



EVG 7300 SmartNIL®纳米压印与晶圆级光学系统由单个平台中结合了多种紫外工艺技术，为大批量生产提供解决方案。

EV集团企业技术总监托马斯·格林纳 (Thomas Gröner) 表示：“EV集团深耕纳米压印技术领域二十余年，我们持续在这一重要领域开拓创新，并开发出新的解决方案，满足不断变化的客户需求。EVG 7300是EV集团纳米压印解决方案系列的新成员，将经过SmartNIL平台压印技术与透镜成型和透镜堆叠技术结合于顶级系统，拥有市场上最精确的图形和工艺参数控制精度，为我们的客户带来了前所未有的灵活性，足以满足行业研究和生产需求。”

EVG 7300系统可作为独立工具，也可用作EV集团HERCULES® NIL全集成UV-NIL晶圆解决方案中的集成模块。UV-NIL解决方案可添加额外的后处理步骤，例如激光烧蚀、机械抛光、前道成型处理等，以满足特定工艺的优化需求。EVG 7300系统结合了高吞吐量、高精度光学、多向运动控制、非接触式测量和强大外力控制等技术，达到了业内领先的制造精度（最小可达300纳米）。EVG 7300是一种高度灵活的平台，支持三种工艺模式（透镜成型、透镜堆叠和SmartNIL纳米压印），支持从150毫米到300毫米晶圆的基板尺寸。该高效平台能够快速加载晶圆和晶圆，快速更换光学组件，提供高功率固化功能，且工具尺寸小巧，能够充分满足行业对新型晶圆级光学系统 (WLO) 产品的制造需求。



SmartNIL 平台集成了晶圆级压印和透镜堆叠技术，能够在单个平台中实现多种紫外工艺。

### 产品上市信息

EV集团现已开始接受该系统的订单。同时，可在EV集团总部和NIL Photonics®技术中心观看产品展示。

### 关于 EV 集团(EVG)

EV集团 (EVG) 是为半导体、微机电系统 (MEMS)、化合物半导体、功率器件和封装技术器件制造提供设备与工艺解决方案的领先供应商。主要产品包括：晶圆键合、薄膜层处理、光刻/纳米压印 (NIL) 与计量设备，以及光源设备、激光器和检测系统。EV集团成立于1980年，可为全球各地的客户和合作伙伴提供设备与服务支持。

